

硅微机械传感器



作者：M. Elwenspoek, R. Wiegerink著；陶家渠等译

出版社：北京:中国宇航出版社, 2003. 09

总页数：306

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11117410.html>）查找全本阅读方式

硅微机械传感器 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11117410.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11117410.html>

书名：硅微机械传感器